322 45巻5号(1993.5)

生産研究

UDC 621.372.8: 535.3/.5.09

特 集 2 研究解説

プロトン交換ニオブ酸リチウム光導波路および イオン交換 KTP 光導波路の光損傷耐性

Photorefractive Sensitivity of the Proton-exchanged LN Optical Waveguides and the Ion-exchanged KTP Optical Waveguides

近藤由紀子*・岡田恵子*・藤井陽一* Yukiko KONDO, Keiko OKADA and Yoich FUJII

コヒーレントな短波長を得るための SHG 寮子の有望な材料であるニオブ酸リチウムのプロト ン交換光導波路,および KTP 結晶の Rb イオン交換光導波路の光損傷感度を定量的に測定し た.プロトン交換導波路は、アニール無しの場合,TI 拡散導波路よりも約10⁶倍光損傷に強い が、アニールにより光損傷に対する耐性は減少する、KTP 光導波路は350℃で数時間アニール したプロトン交換導波路とほぼ同程度の光損傷耐性を持つ.

1. はじめに

最近, CD 用の光源, あるいはレーザプリンター用の 光源としてのコヒーレントで安定な短波長の光に対する 需要が急速に高まってきている. 短波長の光を得る最も 簡易な方法は,結晶に光を通してその光の 1/2 の波長の 光を得る第二高調波発生(SHG)を用いる方法である. ニオブ酸リチウム, タンタル酸リチウム, KTP 等の誘 電体光学結晶は, 第二高調波発生用素子として広く研究 されつつある^{1),2)}.

第二高調波発生効率をあげるうえで、最も大きな障害 となるのは、パワー密度の大きい光の入射により、屈折 率が変化する現象、すなわち光損傷(photorefractive effect)の問題である.この現象により、基本波がある パワー以上になると SHG の効率が減少してしまうこと になる.

ニオブ酸リチウム結晶, KTP (potassium titanyl phosphate)結晶は、2次の非線形光学定数が大きいた め SHG 素子の材料として適している.また、導波路型 SHG 素子は光の閉じ込めがよいので、効率を上げるの に有効である.ニオブ酸リチウム, KTP 結晶は、それ ぞれプロトン交換法、イオン交換法により簡単に光導波 路を形成できるという利点があるが、その光導波路の光 損傷の定量的な測定はほとんど行われていない.

そこでわれわれは,SHG 素子の代表的な材料である ニオブ酸リチウム (MgO ドープ結晶およびノンドープ 結晶)のプロトン交換導波路,および光損傷に強いこと で注目されている KTP 結晶のイオン交換導波路の光損 傷感度を定量的に測定し,比較した.

*東京大学生産技術研究所 第3部

2. 試料の作製

(1) プロトン交換によるニオブ酸リチウム光導波路の 作製

z-cut ニオブ酸リチウム結晶および z-cutMgO ドープ ニオブ酸リチウム結晶にプロトン交換法により光導波路 を作製した.

プロトン交換は、図1のような炉の中で、一定の交換



図1 プロトン交換法

表1 プロトン交換導波路の作製条件

	1	Initial depth of PE layer	Annealing conditions	
LN (z-cut)	A B1 B2 B3	2.1μm 0.32μm 0.31μm 0.25μm	no annealing 350°C 2h 350°C 4h 350°C 4h	
Mg0-doped LN(z-cut)	NO N1 N2	1.9μm 0.47μm 0.35μm	no annealing 350°C 2h 352°C 4h	

温度に保った安息香酸中に結晶を浸して行った.交換温 度は200℃~230℃で,時間は20分~5時間である.プロ トン交換後,大気中,350℃で数時間アニールを行った. アニールの条件を表1に示す.

(2) イオン交換 KTP 導波路の作製

z-cutKTP 結晶を320℃程度の温度に保った RbNO₃ 溶 融塩中につけて一定の温度に保つと,結晶中の K⁺イオ ンと Rb⁺イオンとが交換されて,イオン交換による光 導波路が形成される.

イオン交換の際に $RbNO_3$ 中に $Ba(NO_3)_2$ を混ぜると, 塩の融点が下がり、また、 Ba^{2+} イオンの働きにより、 Rb^+ イオンを結晶中により深く拡散することができる³⁾.

KTP 結晶を RbNO₃ と Ba (NO₃)₂の溶融塩につけ, 320℃に保って、イオン交換法により平面導波路を作製 した. (図 2 参照) KTP 光導波路の作製条件を表 2 に示



図2 Rbイオン交換 KTP 光導波路の作製法

表2 Rbイオン交換 KTP 導波路の作製

5	Diffusion Temperature	time	Ba(NO ₃) ₂ /RbNO ₃ mo1%	
K1	320 °C	45 m in	3%	
K2	320 ℃	10min	15%	

す.

3. 光損傷の測定法

光損傷の測定には,ホログラフィックグレーティング 法を用いた.

図3に示すように Ar レーザ(514.5nm)をハーフ ミラーで2光束に分け、レンズで絞った後、ルチルプリ ズムに入射して導波路内で干渉させる.

光損傷が起こって屈折率変化が生じると、干渉により、 屈折率変調型のグレーテイングが形成される.

このグレーティングに対する He-Ne レーザの回折効 率を測定し、次式より光損傷による屈折率変化 *An* を求 めることができる⁴⁾.

ただし, L は干渉長 (4mm), θ はブラッグ角, λ はへ リウムネオンレーザの波長 (632. 8nm) である.

4. 測 定 結 果

Ar レーザの照射時間に対する He-Ne レーザの回折 効率の変化を図4 ~ 図8 に示す.

図4は、ノンドープのニオブ酸リチウム上に作製した プロトン交換導波路について、回折効率を測定したもの である.プロトン交換層をアニールした試料の光損傷に よる屈折率変化は、図中に示すようなエネルギー密度の 光を試料B1,B2,B3にそれぞれ10秒程度、照射すると 飽和値(あるいは最大値)に達することがわかる.これ に対し、プロトン交換層をアニールしていない試料 (A)は、エネルギー密度1.3×10⁴(W/cm²)の光を約 700秒照射したとき、飽和値に達する.(図5参照)

図6は、MgOドープニオブ酸リチウム結晶上に作製 したプロトン交換導波路の回折効率を測定したものであ る.プロトン交換層をアニールした試料M1,M2の光損 傷による屈折率変化が、図中に示すエネルギー密度の光 の照射により、20秒程度で飽和するのに対し、アニール なしの試料M0においては、エネルギー密度1.8×10⁴ (W/cm²)の光を800秒照射したとき飽和値に達する. (図7参照)



図3 実験系







以上より, MgO ドープの有無にかかわらず, アニー ルなしの試料はアニールした試料に比べて光損傷を受け にくく, 高密度の光を当てないと光損傷を起こさないこ とがわかる.

図8に作製条件の異なる Rb イオン交換 KTP 光導波 路について,回折効率を測定した結果を示す.

また,図4~図8のグラフから求めた光損傷感度の測 定結果を表3に示す.ただし,光損傷感度Sは,導波 路内のエネルギー密度をEとすると,



図7 プロトン交換 MgO ドープ LN (MO) の回折効率



$S = \Delta n/E$

で定義される.

アニールなしのプロトン交換導波路(拡散深さ2 μ m) の光損傷感度は、ノンドープの場合も MgO ドープの場 合も10⁻¹¹~10⁻¹² (cm²/J) であったが、350℃で数時 間のアニールすることにより10⁻⁹~10⁻⁸ (cm²/J) に増 加し、光損傷に対して10⁻²~10⁻³倍弱くなった.この ようにプロトン交換層をアニールする時間が増加するに つれて、導波路の光損傷耐性が減少する.

Rb イオン交換 KTP 光導波路の光損傷感度は、導波 路の作製条件によりやや異なるが、 $10^{-9} \sim 10^{-10}$ 程度で あった.

5. 結 論

ニオブ酸リチウム (MgO ドープ結晶およびノンドー プ結晶)のプロトン交換導波路, KTP 結晶の Rb イオ ン交換導波路の光損傷感度を定量的に測定した^{5),6)}.

光スイッチ,光変調器等によく利用されているニオブ 酸リチウムの Ti 拡散導波路の光損傷感度はノンドープ の結晶を用いた場合,10⁻⁷ (cm²/J)のオーダーである

	Sample	Diffusion Depth	Energy density (J/cm [*])	Diffraction efficiency ŋ(%)	Δn/E (cm²/J)
LN (z-cut)	A B1 B2 B3	2.1μm 2.1μm 1.8μm 3.7μm	1.1×10^{6} 4.0×103 1.0×10^{3} 9.9×10^{2}	$0.74 \\ 0.62 \\ 1.0 \\ 1.0 \\ 1.0$	$\begin{array}{c} 3.8 \times 10^{-12} \\ 0.98 \times 10^{-9} \\ 5.0 \times 10^{-9} \\ 5.2 \times 10^{-9} \end{array}$
MgO-doped LN(z-cut)	MO M1 M2	1.9μm 1.9μm 4.7μm	2.7×10^{5} 2.6×10^{3} 3.6×10^{2}	0.9 1.5 1.0	${}^{1.8\times10^{-11}}_{2.3\times10^{-9}}_{1.4\times10^{-8}}$
KTP (z-cut)	K1 K2	13μm 11μm	$^{6.7 \times 10^{3}}_{7.4 \times 10^{2}}$	0.5 1.0	5.2×10 ⁻¹⁰ 6.8×10 ⁻⁹

表3 プロトン交換ニオブ酸リチウム光導波路および KTP イオン交換光導波路の光損傷感度

ことが報告されている⁷⁾. ニオブ酸リチウムのプロトン 交換導波路は,アニール無しの場合,Ti 拡散導波路よ りも約10⁴倍強いが,アニールにより,光損傷に対する 耐性は減少する.

ニオブ酸リチウムはプロトン交換すると、結晶の構造 が変化し結晶の対称性がよくなるため、電気光学定数が 減少する⁸⁾.アニールによりプロトンが基板中に拡散さ れると、結晶構造がもとの結晶に近づくため、電気光学 定数が回復する^{9),10)}

光損傷は電気光学効果を介して起こる減少なので,プ ロトン交換層の形成により著しく向上した光損傷耐性が, アニールにより劣化するのは,プロトン交換導波路の電 気光学定数がアニールによって回復すること^{9),10)}に主 な原因があると考えられる.

MgOをドープしたニオブ酸リチウム結晶はノンドー プの結晶に比べて光損傷に強いことが知られている.し かし,この二種類の結晶にプロトン交換法で光導波路を 形成し,プロトン交換層の光損傷感度を測定,比較した 場合,MgOドープの効果によるプロトン交換層の光損 傷耐性の向上はとくにみられなかった.アニールした場 合ついても,両者は光損傷に関してほぼ同様の特性を示 した.

KTP のイオン交換光導波路は、光損傷に対し、実用 上よく用いられる条件でアニールしたプロトン交換光導 波路とほぼ同程度、あるいはやや大きめの耐性をもつこ とがわかった.上記の結果は、硝酸バリウム添加量等の 作製条件を選ぶことにより光損傷に対して強いものを作 製することが可能なことを示唆しており、この点で KTP イオン交換導波路は SHG 素子の有望な材料であ ると思われる.

6. おわりに

日頃から,貴重な御指導,御援助をいただいている, パイオニア株式会社の尾上篤氏,宮口敏氏,松下電器株 式会社の谷内哲夫氏,山本和久氏に心から感謝致します. (1993年2月12日受理)

参考文献

- E. J. Lim, M. M. Fejer, R. L. Byer and E. J. Kozlovsky, Electron. Lett., 25, 731 (1989)
- Y. Yamamoto, K. Mizuuchi, K. Takeshige, Y. Sasai and T. Taniuchi, J. Appl. Phys. 71, (4), 15 August 1991.
- J. B. Bierlein, and H. Vanherzeele, J. Opt. Soc. Amer. B, 6, p622 (1988)
- J. L. Jackel, D. H. Olson and A. M. Glass, J. Appl. Phys., 52, pp 4855-4856 (1981)
- 5) 近藤 由紀子,藤井 陽一,第39回応用物理関係連合講 演会,30p-G-12 (1992年 春季)
- Yukiko KONDO, Yoichi Fujii, Jason E. SQUIRE, and Satoshi MIYAGUCHI, Tenth Topical Meeting on GRADIENT-INDEX OPTICAL SYSTEMS, T.5.5, PP 171-174 (1992)
- 近藤 由紀子,レー ティティ,藤井 陽一,本保 栄 治,第38回応用物理関係連合講演会,29a-SF-2 (1991 年 春季)
- 8) Yukiko KONDO, Li HU and Yoichi FUJII, IEICE TRANSACTIONS, VOL. E 71, NO. 11 (1988)
- M. Rottschalk, A. Rasch, W. Karte, J. Opt. Commun. 9 (1988) 1, 19-23
- 10) T. Lay, Y. Kondo, and Y. Fujii, IEICE TRANSAC-TIONS, VOL. E 74, NO. 11 (1991)